

# 关于对宇鸿敏芯（山东）电子科技有限公司 溅射薄膜压力传感器项目环境影响报告表的审批意见

淄高新环报告表[2023]50 号

宇鸿敏芯（山东）电子科技有限公司：

你公司报来的《溅射薄膜压力传感器项目环境影响报告表》已收悉，经审核和现场勘察该项目位于高新区中润大道 158 号 MEMS 产业园 10 号楼，租用现有厂房，用地面积 4500 平方米，投资 14000 元，建成后年产敏感芯体 10 万只、溅射薄膜压力传感器 2.5 万只。根据环评结论，该项目在落实环评提出的各项污染治理措施后能够达到环保要求。经研究提出如下意见和要求：

一、同意你公司在申报地点建设溅射薄膜压力传感器项目。

二、产生废气的工序要安装废气收集及处理装置，确保废气达标排放。运营期 VOCs 排放执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1、表 2 VOCs 排放限值，有组织氟化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值，有组织氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物排放限值。

三、要建设污水处理设施，生产废水经处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 水污染物排放限值和《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）表 2 第二类污染物最高允许排放浓度限值要求后排入城市污水管网；生活污水排入园区化粪池经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准后排入城市污水管网。

四、要加强噪声污染控制，在尽量选用低噪声设备的同时，对各噪声源采取隔音、消声、减振、合理布局等措施，确保该项目运营期间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) II类标准〔昼间 60DB (A)，夜间 50DB (A)〕的要求。

五、要建设符合规范要求的固体废物暂存场所，项目运行过程中产生的废研磨液、废抛光液、废清洗液、废光刻胶、废显影液、废除胶液、废活性炭、污水处理污泥、废化学品包装容器等要按照危险废物管理规范要求进行贮存、处置，靶材和靶材颗粒、废包装物、废反渗透膜集中收集后外售，生活垃圾要由环卫部门统一收集处理。

六、要严格执行“三同时”制度。项目建成后，你公司应严格按照《建设项目环境保护管理条例》规定要求及时组织竣工环保验收并申请排污许可证，待验收合格并取得排污许可证后方可正式投入生产。

七、若该项目的内容、规模、工艺、地点发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

二〇二三年十一月三十日